

**★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)**

専門委員長 国清辰也 副委員長 品田高宏

幹事 黒田理人・山口 直 幹事補佐 池田浩也

期日 1月30日(月)

会場 機械振興会館地下3階研修1号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分, JR:浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線:御成門駅・大江戸線:赤羽橋駅下車徒歩10分. [http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map\\_kaikan.htm](http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm) TEL [03] 3434-8211)

議題 先端CMOSデバイス・プロセス技術 (IEDM特集)

◎開催プログラムは研究会HP等で御確認下さい.

<http://www.ieice.org/~sdm/jpn/index.html>